

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第1部門第2区分
【発行日】令和3年3月18日(2021.3.18)

【公表番号】特表2020-506015(P2020-506015A)
【公表日】令和2年2月27日(2020.2.27)
【年通号数】公開・登録公報2020-008
【出願番号】特願2019-543383(P2019-543383)
【国際特許分類】
A 6 1 M 27/00 (2006.01)
【FI】
A 6 1 M 27/00

【手続補正書】

【提出日】令和3年2月8日(2021.2.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

組織部位を治療するように構成されたドレッシングアセンブリにおいて、
前記組織部位に減圧を分配するように構成されたマニホールドであって、第1の側面と、前記第1の側面と反対側の第2の側面と、前記第1の側面と前記第2の側面との間の厚さを備え、前記第2の側面が前記組織部位に面するように構成されるマニホールドと、
前記第1の側面から、前記マニホールドの前記厚さ内に、前記第2の側面に向かって延びる第1の収縮ゾーンであって、第1の量だけ収縮するように構成される第1の収縮ゾーンと、

前記第1の収縮ゾーンから、前記マニホールドの前記厚さ内に、前記第2の側面に向かって延びる第2の収縮ゾーンであって、前記マニホールドに減圧が加えられたときに前記第1の量よりも大きな第2の量だけ収縮するように構成された第2の収縮ゾーンとを備えることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項2】

請求項1に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記マニホールドの前記第2の側面と前記組織部位との間に位置決めされるように構成されたインターフェース層を更に備えることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項3】

請求項2に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記インターフェース層が、織布材料、不織布材料、ポリエステル製編地材料、および有窓フィルムからなる群から選択されることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項4】

請求項2に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記インターフェース層が抗菌材料を含むことを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項5】

請求項1に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記マニホールドを覆い、前記組織部位に対する密封空間を作り出すように構成された密封部材を更に備えることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項6】

請求項5に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記密封部材が液不透過性フィル

ムを含むことを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 7】

請求項 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記第 2 の収縮ゾーンの少なくとも一部分が前記マニホールドの前記第 2 の側面に位置決めされることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 8】

請求項 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記第 2 の収縮ゾーンが、前記第 1 の収縮ゾーンと前記組織部位との間に位置決めされるように構成されることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 9】

請求項 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記第 1 の収縮ゾーンおよび前記第 2 の収縮ゾーンが各々、異なる機械的特性を有するように構成された前記マニホールドの一部分を含むことを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 10】

請求項 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記第 1 の収縮ゾーンおよび前記第 2 の収縮ゾーンが等量の前記減圧にさらされたときに、前記第 1 の収縮ゾーンが前記第 1 の量だけ収縮するように構成され、かつ前記第 2 の収縮ゾーンが前記第 2 の量だけ収縮するように構成されることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 11】

請求項 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記第 1 の収縮ゾーンおよび前記第 2 の収縮ゾーンが、前記マニホールドの幅にわたって延びることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 12】

請求項 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、機械力または電荷に応答して、前記第 1 の収縮ゾーンが前記第 1 の量だけ収縮するように構成され、かつ前記第 2 の収縮ゾーンが前記第 2 の量だけ収縮するように構成されることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 13】

請求項 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記マニホールドが発泡体を含むことを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 14】

請求項 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記マニホールドが単一層を備えることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 15】

請求項 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記第 1 の収縮ゾーンが前記マニホールドの第 1 の層を含み、かつ前記第 2 の収縮ゾーンが前記マニホールドの第 2 の層を含むことを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 16】

請求項 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記第 1 の収縮ゾーンが前記第 2 の収縮ゾーンよりも大きな剛性を有することを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 17】

請求項 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記第 2 の収縮ゾーンが前記第 1 の収縮ゾーンの深さよりも大きな深さまで前記マニホールドの前記厚さ内に延びることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 18】

請求項 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記第 1 の収縮ゾーンおよび前記第 2 の収縮ゾーンが発泡体を含み、かつ前記第 2 の収縮ゾーンにおける前記発泡体の多孔率が前記第 1 の収縮ゾーンにおける前記発泡体の多孔率よりも大きいことを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 19】

請求項 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記マニホールドの前記厚さに実質的に垂直な方向に、前記第 1 の収縮ゾーンが前記第 1 の量だけ収縮するように構成され、かつ前記第 2 の収縮ゾーンが前記第 2 の量だけ収縮するように構成されることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 2 0】

請求項 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記組織部位に対して横方向に、前記第 1 の収縮ゾーンが前記第 1 の量だけ収縮するように構成され、かつ前記第 2 の収縮ゾーンが前記第 2 の量だけ収縮するように構成されることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 2 1】

請求項 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記第 1 の収縮ゾーンの前記第 1 の収缩量および前記第 2 の収縮ゾーンの前記第 2 の収缩量が、前記マニホールドの前記厚さに実質的に垂直な方向に前記マニホールドの寸法を低減することを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 2 2】

請求項 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記マニホールドの前記第 2 の側面は、前記第 1 の収縮ゾーンが前記第 1 の量だけ収縮し、かつ前記第 2 の収縮ゾーンが前記第 2 の量だけ収縮したときに前記組織部位に面するように構成された凹形状を形成するように構成されることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 2 3】

請求項 1 に記載のドレッシングアセンブリを備える、組織部位を治療するための治療システムにおいて、

前記マニホールドの前記第 2 の側面と前記組織部位との間に位置決めされるように構成されたインターフェース層と、

前記マニホールドを覆い、前記組織部位に対する密封空間を作り出すように構成された密封部材と、

前記密封空間と流体連通して結合され、前記密封空間に前記減圧をもたらすように構成された減圧源と

を更に備え、

前記減圧が前記マニホールドに対する圧縮力を生成することを特徴とする治療システム。

【請求項 2 4】

組織部位を治療するための治療システムにおいて、

第 1 の側面と第 2 の側面とを備えるドレッシングボルスタであって、前記第 2 の側面が前記組織部位に面するように構成され、前記ドレッシングボルスタが減圧にさらされたときに前記組織部位に対して横方向に第 1 の量だけ収縮するように構成されたドレッシングボルスタと、

第 1 の側面と第 2 の側面とを備える快適層であって、前記快適層の前記第 1 の側面が前記ドレッシングボルスタの前記第 2 の側面上に位置決めされ、前記快適層が、前記減圧にさらされたときに前記組織部位に対して横方向に第 2 の量だけ収縮するように構成され、前記第 2 の量が前記第 1 の量よりも大きい快適層と、

前記ドレッシングボルスタを覆い、前記組織部位に対する密封空間を作り出すように構成された密封部材と

を備えることを特徴とする治療システム。

【請求項 2 5】

請求項 2 4 に記載の治療システムにおいて、前記ドレッシングボルスタが発泡体を含むことを特徴とする治療システム。

【請求項 2 6】

請求項 2 4 に記載の治療システムにおいて、前記快適層が、織布材料、不織布材料、ポリエステル製編地材料、および有窓フィルムからなる群から選択されることを特徴とする

治療システム。

【請求項 27】

請求項 24 に記載の治療システムにおいて、前記密封部材が、前記密封空間に前記減圧をもたらすための減圧源と流体連通して結合されるように構成された液不透過性フィルムを含むことを特徴とする治療システム。

【請求項 28】

請求項 24 に記載の治療システムにおいて、前記快適層の前記第 2 の側面の少なくとも一部分が、前記組織部位に直接接触するように構成されることを特徴とする治療システム。

【請求項 29】

請求項 24 に記載の治療システムにおいて、前記快適層の前記第 2 の側面上に位置決めされたインターフェースシールを更に備え、前記インターフェースシールが親水コロイドを含むことを特徴とする治療システム。

【請求項 30】

請求項 29 に記載の治療システムにおいて、前記快適層の前記第 2 の側面的一部分が前記インターフェースシールを有さないことを特徴とする治療システム。

【請求項 31】

請求項 29 に記載の治療システムにおいて、前記快適層が、前記ドレッシングボルスタの周縁部と実質的に整合された周縁部を有し、前記ドレッシングボルスタの前記周縁部が前記ドレッシングボルスタの外側境界を画定し、かつ前記インターフェースシールが前記ドレッシングボルスタの前記周縁部に位置決めされることを特徴とする治療システム。

【請求項 32】

請求項 31 に記載の治療システムにおいて、前記インターフェースシールの一部分が、前記ドレッシングボルスタの前記周縁部を越えて延びることを特徴とする治療システム。

【請求項 33】

請求項 24 に記載の治療システムにおいて、前記ドレッシングボルスタが、前記ドレッシングボルスタの厚さに実質的に垂直な方向に前記第 1 の量だけ収縮するように構成され、かつ前記快適層が、前記快適層の厚さに実質的に垂直な方向に前記第 2 の量だけ収縮するように構成されることを特徴とする治療システム。

【請求項 34】

請求項 24 に記載の治療システムにおいて、前記ドレッシングボルスタの前記第 1 の収缩量および前記快適層の前記第 2 の収缩量が、前記ドレッシングボルスタおよび前記快適層の厚さに実質的に垂直な方向に前記ドレッシングボルスタおよび前記快適層の寸法を低減することを特徴とする治療システム。

【請求項 35】

請求項 24 に記載の治療システムにおいて、前記快適層の前記第 2 の側面は、前記ドレッシングボルスタが第 1 の量だけ収縮しかつ前記快適層が前記第 2 の量だけ収縮したときに凹形状を形成するように構成されることを特徴とする治療システム。

【請求項 36】

請求項 24 に記載の治療システムにおいて、前記ドレッシングボルスタが、前記組織部位に減圧を分配するように構成されることを特徴とする治療システム。

【請求項 37】

請求項 24 に記載の治療システムにおいて、前記快適層が、前記ドレッシングボルスタに結合されない少なくとも 1 つの縁部を備えることを特徴とする治療システム。

【請求項 38】

請求項 24 に記載の治療システムにおいて、前記快適層が前記ドレッシングボルスタに結合されないことを特徴とする治療システム。

【請求項 39】

請求項 24 に記載の治療システムにおいて、前記快適層の少なくとも一部分が、前記ドレッシングボルスタから独立して移動可能であることを特徴とする治療システム。

【請求項 40】

組織部位を治療するように構成されたドレッシングアセンブリにおいて、

収縮し、前記組織部位に減圧を分配するように構成された多孔質材料を備えるマニホールドであって、第1の側面と、前記第1の側面と反対側の第2の側面と、前記第1の側面と前記第2の側面との間の厚さとを更に備え、前記第2の側面が前記組織部位に面するように構成されるマニホールドと、

前記マニホールドの前記第1の側面に結合され、かつ前記マニホールドが前記減圧にさらされたときに前記マニホールドの前記第2の側面が前記第1の側面よりも大きな量だけ収縮するように構成されるように前記マニホールドの前記第1の側面を支持するように構成された補強部材と

を備えることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 41】

請求項40に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記マニホールドの前記第2の側面と前記組織部位との間に位置決めされるように構成されたインターフェース層を更に備えることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 42】

請求項40に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記マニホールドを覆い、前記組織部位に対する密封空間を作り出すように構成された密封部材を更に備えることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 43】

請求項40に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記マニホールドの少なくとも一部分が、前記補強部材と前記組織部位との間に位置決めされるように構成されることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 44】

請求項40に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記補強部材が、前記マニホールドの前記第2の側面と比較して前記マニホールドの前記第1の側面における収縮量を低減するように構成されることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 45】

請求項40に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記補強部材が、前記マニホールドの前記第1の側面における収縮を妨げるように構成されることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 46】

請求項40に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記補強部材が前記マニホールドの剛性よりも大きな剛性を備えることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 47】

請求項40に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記補強部材が前記マニホールドの前記第1の側面の少なくとも一部分を覆うように位置決めされることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 48】

請求項40に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記補強部材が前記マニホールドの前記第1の側面にわたって位置決めされることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 49】

請求項40に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記補強部材が前記マニホールドの前記第1の側面の周縁部に位置決めされることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 50】

請求項40に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記マニホールドが発泡体を含むことを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 51】

請求項 40 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記マニホールドの前記第 1 の側面および前記第 2 の側面は、前記マニホールドが前記減圧にさらされたときに前記マニホールドの前記厚さに実質的に垂直な方向に大きさが低減するように構成され、かつ前記マニホールドの前記第 2 の側面は前記マニホールドの前記第 1 の側面よりも大きさが低減するように構成されることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 52】

請求項 40 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記マニホールドの前記第 1 の側面および前記第 2 の側面は前記組織部位に対して横方向に大きさが低減するように構成され、かつ前記マニホールドの前記第 2 の側面は前記マニホールドの前記第 1 の側面よりも大きさが低減するように構成されることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 53】

請求項 40 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記マニホールドは前記減圧にさらされたときに大きさが低減することを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 54】

請求項 40 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記マニホールドが、可撓性であるとともに、前記マニホールドが前記減圧にさらされたときに大きさが低減するように構成された複数の相互接続された細孔を含むことを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 55】

請求項 40 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記マニホールドが、可撓性であるとともに、前記マニホールドが前記減圧にさらされたときに大きさが低減するように構成される前記マニホールドの前記第 1 の側面および前記第 2 の側面に近接する複数の相互接続された細孔を含み、かつ前記マニホールドの前記第 2 の側面に近接する前記複数の相互接続された細孔は、前記マニホールドの前記第 1 の側面に近接する前記複数の相互接続された細孔よりも大きさが低減することを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 56】

請求項 40 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記マニホールドが、可撓性であるとともに、前記マニホールドが前記減圧にさらされたときに大きさが低減するように構成される前記マニホールドの前記第 1 の側面および前記第 2 の側面に近接する複数の相互接続された細孔を含み、かつ前記補強部材は、前記第 2 の側面に近接する前記相互接続された細孔が前記第 1 の側面に近接する前記相互接続された細孔よりも大きさが低減するように、前記第 1 の側面に近接する前記相互接続された細孔を支持することを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 57】

請求項 56 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記補強部材が、前記マニホールドの前記第 1 の側面に近接する前記相互接続された細孔の少なくとも一部分を塞ぐことを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 58】

請求項 56 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記補強部材が、前記マニホールドの前記第 1 の側面に近接する前記相互接続された細孔の少なくとも一部分の変形を実質的に妨げることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 59】

請求項 56 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記補強部材が、前記マニホールドの前記第 1 の側面に近接する前記相互接続された細孔の少なくとも一部分の大きさの変化を実質的に妨げることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 60】

請求項 40 に記載のドレッシングアセンブリを備える、組織部位を治療するための治療システムにおいて、

前記マニホールドの前記第 2 の側面と前記組織部位との間に位置決めされるように構成されたインターフェース層と、

前記マニホールドを覆い、前記組織部位に対する密封空間を作り出すように構成された

密封部材と、

前記密封空間と流体連通して結合され、前記密封空間に前記減圧をもたらすように構成された減圧源と

を更に備えることを特徴とする治療システム。

【請求項 6 1】

組織部位を治療するように構成されたドレッシングアセンブリにおいて、

発泡体を含むとともに、収縮し、前記組織部位に減圧を分配するように構成されたマニホールドであって、第 1 の側面と、前記第 1 の側面と反対側の第 2 の側面と、前記第 1 の側面と前記第 2 の側面との間の厚さとを更に備え、前記第 2 の側面が前記組織部位に面するように構成されるマニホールドと、

前記マニホールドが前記減圧にさらされたときに前記マニホールドの前記第 2 の側面が前記第 1 の側面よりも大きな量だけ収縮するように構成されるように前記マニホールドを支持するように構成された補強部材と

を備えることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 6 2】

請求項 6 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記補強部材が、可撓性であるとともに、前記マニホールドの前記第 2 の側面と比較して前記マニホールドの前記第 1 の側面における収縮量を低減するように構成されることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 6 3】

請求項 6 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記補強部材が、前記マニホールドの前記第 1 の側面における収縮を妨げるように構成されることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 6 4】

請求項 6 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記補強部材が前記マニホールドの剛性よりも大きな剛性を備えることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 6 5】

請求項 6 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記補強部材が前記マニホールドの前記第 1 の側面の少なくとも一部分を覆うように位置決めされることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 6 6】

請求項 6 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記補強部材が前記マニホールドの前記第 1 の側面にわたって位置決めされることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 6 7】

請求項 6 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記補強部材が前記マニホールドの前記第 1 の側面の周縁部に位置決めされることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 6 8】

請求項 6 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記補強部材が前記マニホールドの少なくとも一部分に組み込まれることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 6 9】

請求項 6 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記マニホールドの前記第 1 の側面および前記第 2 の側面は、前記マニホールドが前記減圧にさらされたときに前記マニホールドの前記厚さに実質的に垂直な方向に大きさが低減するように構成され、かつ前記マニホールドの前記第 2 の側面は前記マニホールドの前記第 1 の側面よりも大きさが低減するように構成されることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 7 0】

請求項 6 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記マニホールドが、可撓性であるとともに、前記マニホールドが前記減圧にさらされたときに大きさが低減するように

構成される前記マニホールドの前記第 1 の側面および前記第 2 の側面に近接する複数の相互接続された細孔を含み、かつ前記マニホールドの前記第 2 の側面に近接する前記複数の相互接続された細孔は、前記マニホールドの前記第 1 の側面に近接する前記複数の相互接続された細孔よりも大きさが低減することを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 7 1】

請求項 6 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記マニホールドが、可撓性であるとともに、前記マニホールドが前記減圧にさらされたときに大きさが低減するように構成される前記マニホールドの前記第 1 の側面および前記第 2 の側面に近接する複数の相互接続された細孔を含み、かつ前記補強部材は、前記第 2 の側面に近接する前記相互接続された細孔が前記第 1 の側面に近接する前記相互接続された細孔よりも大きさが低減するように、前記第 1 の側面に近接する前記相互接続された細孔を支持することを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 7 2】

請求項 7 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記補強部材が、前記マニホールドの前記第 1 の側面に近接する前記相互接続された細孔の少なくとも一部分を塞ぐことを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 7 3】

請求項 7 1 に記載のドレッシングアセンブリにおいて、前記補強部材が、前記マニホールドの前記第 1 の側面に近接する前記相互接続された細孔の少なくとも一部分の大きさの変化を実質的に妨げることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 7 4】

請求項 6 1 に記載のドレッシングアセンブリを備える、組織部位を治療するための治療システムにおいて、

前記マニホールドの前記第 2 の側面と前記組織部位との間に位置決めされるように構成されたインターフェース層と、

前記マニホールドを覆い、前記組織部位に対する密封空間を作り出すように構成された密封部材と、

前記密封空間と流体連通して結合され、前記密封空間に減圧をもたらすように構成された減圧源と

を更に備えることを特徴とする治療システム。

【請求項 7 5】

組織部位を治療するように構成されたドレッシングアセンブリにおいて、

収縮し、前記組織部位に減圧を分配するように構成されたマニホールドであって、第 1 の側面と、前記第 1 の側面と反対側の第 2 の側面とを更に備え、前記第 2 の側面が前記組織部位に面するように構成されるマニホールドと、

前記マニホールドが前記減圧にさらされたときに前記マニホールドの前記第 2 の側面が前記第 1 の側面よりも大きな量だけ収縮するように構成されるように前記マニホールドを支持するように構成された補強部材と

を備えることを特徴とするドレッシングアセンブリ。

【請求項 7 6】

組織部位に減圧を分配するように構成されたマニホールドにおいて、前記マニホールドが、第 1 の量だけ収縮するように構成された第 1 の側面と、前記第 1 の側面と反対側の第 2 の側面とを備え、前記第 2 の側面が、前記減圧にさらされたときに前記第 1 の量よりも大きな第 2 の量だけ収縮するように構成されることを特徴とするマニホールド。

【請求項 7 7】

組織部位を治療するように構成されたドレッシングアセンブリにおいて、

マニホールドであって、前記マニホールドの第 1 の側面および第 2 の側面に近接する複数の相互接続された細孔を含む可撓性発泡体を含み、前記第 1 の側面が、前記第 2 の側面と反対側に位置決めされるとともに、前記マニホールドの厚さによって前記第 2 の側面から離隔され、前記第 2 の側面が前記組織部位に面するように構成されるマニホールドと

前記マニホールドが減圧にさらされたときに前記マニホールドの前記第 2 の側面に近接する前記相互接続された細孔が前記マニホールドの前記第 1 の側面に近接する前記相互接続された細孔よりも大きさが低減するように、前記マニホールドを支持するように構成された補強部材と
を備えることを特徴とするドレッシングアセンブリ。